

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile
Grundlegende Prüf- und MessverfahrenTeil 3-16: Untersuchungen und Messungen – Endflächenradius sphärisch polierter Stifte
(IEC 61300-3-16:2003) Deutsche Fassung EN 61300-3-16:2003**DIN****EN 61300-3-16**

ICS 33.180.20

Ersatz für
DIN EN 61300-3-16:1998-09
Siehe Beginn der Gültigkeit

Fibre optic interconnecting devices and passive components –
Basic test and measurement procedures – Part 3-16: Examinations
and measurements – Endface radius of spherically polished ferrules
(IEC 61300-3-16:2003); German version EN 61300-3-16:2003

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques –
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 3-16: Examens et mesures – Rayon de la face terminale des
embouts polis sphériquement (CEI 61300-3-16:2003);
Version allemande EN 61300-3-16:2003

Die Europäische Norm EN 61300-3-16:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.**Beginn der Gültigkeit**

Die EN 61300-3-16 wurde am 2002-12-01 angenommen.

Daneben darf DIN EN 61300-3-16:1998-09 noch bis 2005-12-01 angewendet werden.

Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 412.7 „LWL-Verbindungstechnik und passive optische Komponenten“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE zuständig.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN IEC 61300-3-16:2001-06.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 86B „Fibre optic interconnecting devices and passive components“ erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2007 unverändert bleiben soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

- bestätigt,
- zurückgezogen,
- durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
- geändert.

Fortsetzung Seite 2
und 12 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE

DIN EN 61300-3-16:2003-09

Änderungen

Gegenüber DIN EN 61300-3-16:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Überarbeitung des Messverfahrens 1 „Zweidimensionale Oberflächenanalyse“;
- Überarbeitung des Messverfahrens 2 „Zweidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse“;
- Herausnahme des Messverfahrens 3 „Profilmessung“.

Frühere Ausgaben

DIN EN 61300-3-16:1998-09

Deutsche Fassung

Lichtwellenleiter-Verbindungselemente und passive Bauteile

Grundlegende Prüf- und Messverfahren

Teil 3-16: Untersuchungen und Messungen – Endflächenradius sphärisch polierter Stifte
(IEC 61300-3-16:2003)

Fibre optic interconnecting devices and passive components –
Basic test and measurement procedures –
Part 3-16: Examination and measurements –
Endface radius of spherically polished ferrules
(IEC 61300-3-16:2003)

Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques –
Méthodes fondamentales d'essais et de mesures –
Partie 3-16: Examens et mesures – Rayon de la face terminale des embouts polis sphériquement (CEI 61300-3-16:2003)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2002-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, der Slowakei, Spanien, der Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Königreich.

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart, 35 B-1050 Brüssel

Vorwort

Der Text des Schriftstücks 86B/1746/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe von IEC 61300-3-16, ausgearbeitet von dem IEC SC 86B „Fibre optic interconnecting devices and passive components“ des IEC TC 86 „Fibre optic“, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstimmung unterworfen und von CENELEC am 2002-12-01 als EN 61300-3-16 angenommen.

Diese Europäische Norm ersetzt EN 61300-3-16:1997.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

- spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop): 2003-10-01
- spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow): 2005-12-01

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 61300-3-16:2003 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als Europäische Norm angenommen.

Inhalt

	Seite
Vorwort.....	2
1 Anwendungsbereich	4
2 Normative Verweisungen.....	4
3 Allgemeine Beschreibung	4
4 Prüfaufbau	4
4.1 Verfahren 1 – Zweidimensionale Oberflächenanalyse.....	4
4.2 Verfahren 2 – Zweidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	5
4.3 Verfahren 3 – Dreidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	7
5 Verfahren	8
5.1 Messbereich	8
5.2 Verfahren 1 – Zweidimensionale Oberflächenanalyse.....	9
5.3 Verfahren 2 – Zweidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	11
5.4 Verfahren 3 – Dreidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	11
6 Festzulegende Einzelheiten	12
6.1 Verfahren 1 – Zweidimensionale Oberflächenanalyse.....	12
6.2 Verfahren 2 – Zweidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	12
6.3 Verfahren 3 – Dreidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	12
Bild 1 – Verrundungsradius der Endfläche	4
Bild 2 – Prüfaufbau für die zweidimensionale Oberflächenanalyse.....	5
Bild 3 – Prüfaufbau für die zweidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	6
Bild 4 – Prüfaufbau für die dreidimensionale interferometrische Oberflächenanalyse.....	7
Bild 5 – Stiftendfläche und Messbereiche.....	9
Bild 6 – Messwerte zur Berechnung des Endflächenradius nach Verfahren 1	10
Bild 7 – Messwerte zur Berechnung des Endflächenradius	11